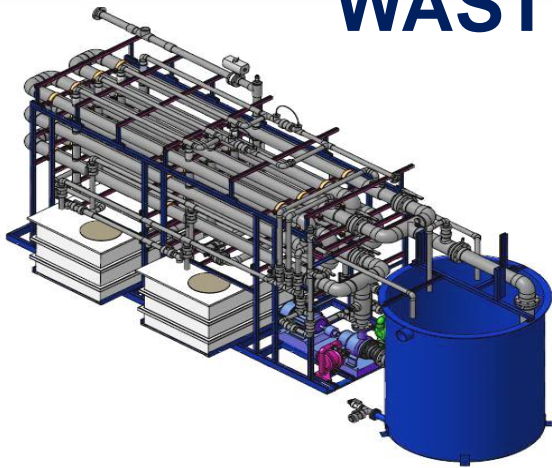


반도체 가공 폐수 재이용

SEMICONDUCTOR PROCESS

WASTE WATER REUSE SYSTEM



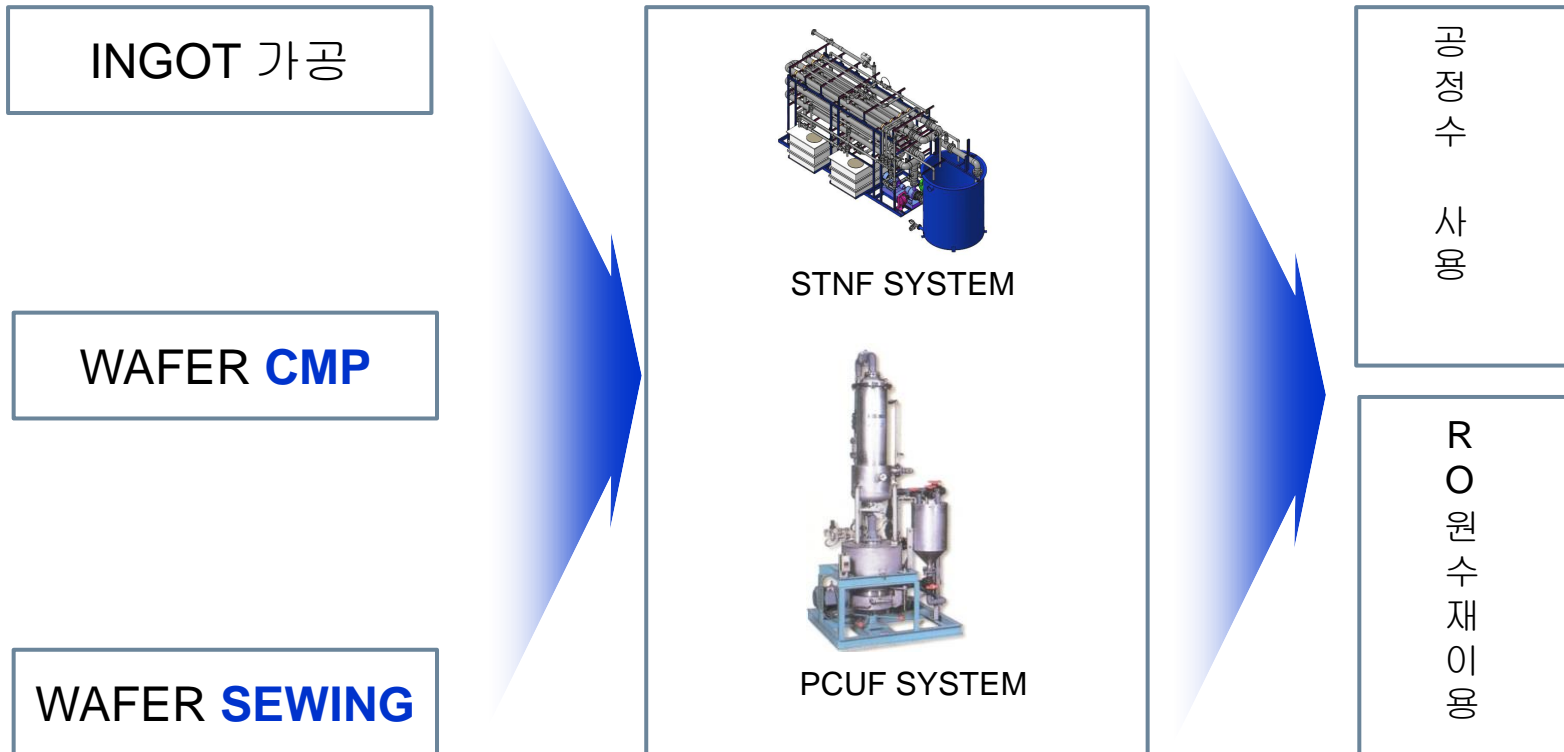
특허 제 10-1336174호
특허 제 20-0450431호



LH LIVING AND HUMAN innovation 수처리 사업부문


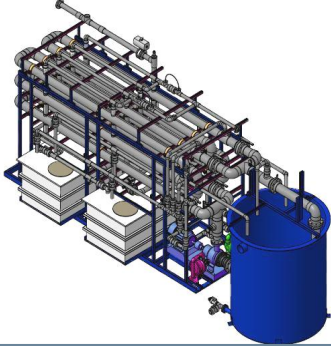
TEL 031-365-4264 FAX 0505-650-7004

1. 1. 반도체 공정별 폐수의 재이용 FLOW



반도체 공정폐수의 정수는 일반적인 **UF** 필터로는 절대 불가능합니다

1. 2. 시스템 소개

PCUF FILTER SYSTEM	STNF SYSTEM
<p>특허 제 20-0450431호</p> 	<p>특허 제 10-1336174호</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • 코팅에 의한 막 형성 후 여과(물리적) • 0.3~0.5μm PORE SIZE의 정밀여과 • 자동 역세척 및 재코팅 • 필터교체가 필요 없음(유지관리비 저렴) • 폐수의 95%이상 재이용 가능 • 비교적 입자크기가 큰 잉곳 가공공정에 적합 	<ul style="list-style-type: none"> • 관형타입의 UF • 0.05μm PORE SIZE의 초정밀 정밀여과 • 자동 역세척 및 필터 CIP • 필터 교체주기: 24~48개월 • 웨이퍼 공정폐수(백그라인딩, 소잉) • 폐수의 90%이상 재이용 가능(RO원수이용)

상세한 사항은 홈페이지(www.lhinno.com)에서 개별 카탈로그를 참조 하세요

LH LIVING AND HUMAN innovation

(주) LH 이노베이션

경기도 안산시 단원구 만해로 205
타원타크라3차 지식산업센터 B523호

Tel.031-365-4264 Fax 0505-650-7004

E-mail lhinn@naver.com www.lhinno.co.kr